

平成 28 年 5 月 10 日

平成 28 年度 JIS 原案作成委員会 1  
委員各位

一般社団法人 日本粉体工業技術協会  
平成 28 年度 JIS 原案作成委員会 1  
委員長 東谷 公

第 1 回 平成 28 年度 JIS 原案作成委員会 1 (通算第 3 回)  
委員会開催のご案内  
(ゼータ電位測定の方法 - 光学的方法)

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は、日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、本委員会を下記にて開催致しますので、ご多忙中恐縮ですが、出席賜りますようお願い申し上げます。

出欠の連絡は 5 月 25 日 (水) までに、下記連絡先にメールにてご連絡くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

日 時 : 平成 28 年 6 月 1 日 (水) 13:30~17:00  
場 所 : 種苗会館 6 階 会議室 (日本粉体工業技術協会 東京事務所階上)  
最寄駅: 東京メトロ丸の内線 本郷三丁目駅 徒歩 3 分  
連絡先: (一社) 日本粉体工業技術協会 東京事務所 大久保  
〒113-0033 東京都文京区本郷 2-26-11 種苗会館 5 階  
TEL : 03-3815-3955 email: okubo@appie.or.jp  
議 題 : 修正案審議、意見統一

以上